

09/125122  
08-11-98

世界知的所有権機関  
国際事務局



PCT

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類6 H01J 9/227		A1	(11) 国際公開番号 WO98/27570
		(43) 国際公開日 1998年6月25日(25.06.98)	
(21) 国際出願番号 PCT/JP97/04643		正木孝樹(MASAKI, Takaki)[JP/JP] 〒520 滋賀県大津市南郷2丁目43番19号 Shiga, (JP)	
(22) 国際出願日 1997年12月16日(16.12.97)		佐野高男(SANO, Takao)[JP/JP] 〒524 滋賀県守山市金森町650-22 Shiga, (JP)	
(30) 優先権データ		北村義之(KITAMURA, Yoshiyuki)[JP/JP] 〒520 滋賀県大津市園山2丁目13番1号	
特願平8/336713	1996年12月17日(17.12.96)	JP	北園寮C424 Shiga, (JP)
特願平9/81555	1997年3月31日(31.03.97)	JP	谷 義則(TANI, Yoshinori)[JP/JP]
特願平9/172339	1997年6月27日(27.06.97)	JP	〒520 滋賀県大津市園山2丁目15番1号 晴園寮368 Shiga, (JP)
特願平9/172354	1997年6月27日(27.06.97)	JP	池内秀樹(IKEUCHI, Hideki)[JP/JP]
特願平9/172364	1997年6月27日(27.06.97)	JP	〒607 京都府京都市山科区竹鼻地藏寺南町16番地A1-44 Kyoto, (JP)
(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 東レ株式会社(TORAY INDUSTRIES, INC.)(JP/JP) 〒103 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 Tokyo, (JP)		(81) 指定国 CA, CN, ID, KR, SG, US. 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).	
(72) 発明者 ; および		添付公開書類 国際調査報告書	
(75) 発明者 / 出願人 (米国についてのみ) 井口雄一朗(IGUCHI, Yuichiro)[JP/JP] 〒520-21 滋賀県大津市一里山1丁目24番8号 Shiga, (JP)			
松本正廣(MATSUMOTO, Masahiro)[JP/JP] 〒520 滋賀県大津市園山2丁目15番1号 晴園寮353 Shiga, (JP)			
三上友子(MIKAMI, Yuko)[JP/JP] 〒525 滋賀県草津市若竹町8-8-201 Shiga, (JP)			
(54)Title: METHOD AND DEVICE FOR MANUFACTURING PLASMA DISPLAY			
(54)発明の名称 プラズマディスプレイの製造方法および製造装置			
(57) Abstract A method for manufacturing plasma display, characterized by forming a phosphor layer on a substrate on which a plurality of partitions are formed, by continuously discharging phosphor pastes containing phosphor powder and an organic compound onto the substrate through a nozzle having a plurality of discharge ports. After three kinds of phosphor pastes respectively containing a phosphor powder which emits red, green, or blue light are applied to the gaps between the partitions in the form of a stripe from the nozzle, the phosphor layer is formed by heating the paste. A device for manufacturing plasma display characterized by being provided with a table on which a substrate with partitions is fixed, a nozzle which is faced to the partitions of the substrate and has discharge openings, means for supplying phosphor paste to the nozzle, and means for three-dimensionally moving the table and the nozzle relative to each other.			